

Laserinterferometersystem ZLM 500, Carl Zeiss Jena



Erfassung von:

- ▶ Positionsabweichungen
- ▶ Längen, Winkel
- ▶ Geradheit, Ebenheit
- ▶ Schwingungen
- ▶ CNC-Steuerungskompensation

Rotatorische Geber, Heidenhain

Erfassung von:

- ▶ Teilungsabweichungen
- ▶ Kombinationen aus Längen (Laser) und Winkelmessungen (z.B. Wälzabweichungen)